

彦根に半導体製造装置生産工場を建設 300ミリウエハ対応洗浄装置を増産

大日本スクリーン製造株式会社(本社:京都市上京区/社長:石田明)は、当社彦根地区事業所(滋賀県彦根市高宮町480-1)の敷地内に、半導体製造装置の新工場「Fab.FC-1(ファブ・エフシーワン)」の建設を決定、2001年4月操業開始を目指し本年10月に着工しました。設備投資額は約20億円を予定しています。

大日本スクリーンは、半導体製造のウエハ処理工程(前工程)で使用するレジスト(感光性樹脂)塗布・現像装置、枚葉式洗浄装置やバッチ式洗浄装置(ウェットステーション)を開発・製造し、国内外に供給しており、現在、これらの装置は主に洛西事業所(京都市伏見区)、野洲事業所(滋賀県野洲町)、彦根地区事業所(滋賀県彦根市)、多賀事業所(滋賀県多賀町)の4拠点で生産しています。

半導体市場の活況により収益が伸びている半導体メーカー各社は、圧倒的な投資力を背景に生産設備の増強を図ろうとしています。特に、従来の200ミリウエハの約2.4倍のチップ数がとれる300ミリウエハに対応した半導体の量産工場が、コスト競争力のさらなる強化と次世代半導体の増産に向かって、2001年初めから2002年にかけて稼働します。このため、300ミリの半導体製造装置の急激な需要増が予想され、中でも当社が世界に先駆けて開発した300ミリ対応の洗浄装置が業界から高い評価を受け、引き合いや受注が活発になっています。一方、洗浄装置の既存工場は、期初計画をはるかに上回る受注増への対応でフル生産の状況が続いており、300ミリ対応洗浄装置の今後の需要に対応できる生産体制の構築が早急に必要になってきています。

新工場は、このような状況を背景に、主にバッチ式洗浄装置「FC-3000」*の生産増強に対応したものの。操業初年度の生産規模は300ミリ対応洗浄装置に換算して100台で、同装置の生産能力を約4倍に引き上げ、洗浄装置のシェア拡大を目指します。

建設規模は、敷地面積約5,400平方メートル、鉄骨3階建て、延べ床面積は約10,000平方メートル。人員数は150名を予定しています。

* バッチ式洗浄装置「FC-3000」

300ミリウエハ対応のワンバス式ウェットステーション。当社の多槽式洗浄装置の開発で培った薬液循環による洗浄技術と、単槽式ウェットステーションで蓄積した薬液置換洗浄技術を融合し、次世代対応装置として開発。ウエハとウエハの間を通常の半分にした(ハーフピッチ化)ことにより、一度に処理するウエハ枚数はそのまま処理槽の小型化を実現。さらに薬液や純水の使用量を低減し、生産性を向上している。装置サイズもコンパクトなので、クリーンルームの省スペース化に有効。1つの槽で薬液・水洗といった一連の処理を行うため、ウエハが大気に触れず、自然酸化膜の発生を抑制できる。

< 新工場の概要 >

- 名称 : 彦根地区事業所「Fab.FC-1(ファブ・エフシーワン)」
名称の由来は、「Fab.」がFabulous(素晴らしい)およびFabricate(造る)に、「FC」はFine Cleaning(ファイン洗浄)と、製造品目の300ミリウエハ対応洗浄装置「FC-3000」の名称に通じるもの。当社21世紀初の工場として、IT活用による設計・生産管理を目指す。
- 所在地 : 滋賀県彦根市高宮町480-1
- 目的 : ウエハ洗浄装置を主とする半導体製造装置の生産
- 着工 : 2000年10月
- 工事完成予定 : 2001年3月
- 操業開始予定 : 2001年4月
- 敷地面積 : 約5,400平方メートル
- 建築面積 : 約4,900平方メートル
- 延べ床面積 : 約10,000平方メートル



彦根地区事業所「Fab.FC-1(ファブ・エフシーワン)」

この画像の印刷用データ(解像度300dpi)は、下記URLよりダウンロードできます。
(<http://www.screen.co.jp/press/photo.html>)